

大塚電子Webセミナー

光を用いた計測・分析機器の開発で培った技術を活かし、
先端技術を支える装置・測定技術・応用例を中心に解説するWebセミナーを開催いたします。

2026.10.15(木) 15:00~16:00 ライブ配信 (ライブ配信では質疑応答を実施します)

2026.10.20(火) 15:00~16:00 アーカイブ配信

お申し込み時にご希望の日時をお選びください

光干渉法を原理とする膜厚測定装置を使いこなすためのノウハウ

光干渉式の膜厚計について、測定がうまくいかない、干渉が見えているのに膜厚がうまく出ない、そもそも測定がうまくいっているかわからない、ということはありませんでしょうか？

光干渉法の原理から測定例、よくある測定の質問、測定のコツなど光干渉法を原理とする膜厚測定装置をより良く使っていただく情報をご紹介します。

* 本セミナーは2026年2月に放映したものを配信いたします。

関連機器



nm オーダーの透明な異物・欠陥の評価が可能

1ショットで高さ方向の情報を取得

非破壊・非接触・非侵襲で測定が可能

光波動場三次元顕微鏡

MINUK

お申し込み方法

本セミナーは無料で参加できます。下記のHPより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

<https://www.otsukael.jp/event/detail/eventid/556>

ご視聴方法：本セミナーは、Microsoft Teams を使用します。



大塚電子株式会社

お問い合わせ

担当：真木・岡本

■本社・営業部 TEL. (072) 855-8550
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3 丁目 26-3

■東京支店 TEL. (042) 644-4951
〒192-0082 東京都八王子市東町 1-6 橋完 LK ビル 2F

□ E-Mail OELJP-webseminar@otsuka.jp